# 02 Излучательные характеристики эксимерных молекул Ar<sub>2</sub>Cl\* при накачке плотной газовой смеси Ar + CCl<sub>4</sub> быстрыми электронами

© А.И. Миськевич<sup>1,2</sup>, А.В. Подкопаев<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ",

115409 Москва, Россия

<sup>2</sup> АО "ГНЦ РФ-ФЭИ" Физико-энергетический институт им. академика А.И. Лейпунского,

242020 Обнинск, Калужская область, Россия

e-mail: aimiskevich@mephi.ru; apodkopaev@ippe.ru

Поступила редакцию 19.04.2021 г. В окончательной редакции 19.04.2021 г. Принята к публикации 13.05.2021 г.

> Исследованы спектрально-временные характеристики люминесценции газовых смесей (Ar+CCl<sub>4</sub>), возбуждаемых импульсным пучком быстрых электронов ( $E_e = 220 \text{ keV}$ , T = 5 ns). Обнаружено, что в плотных газовых смесях происходит образование эксимерных молекул Ar<sub>2</sub>Cl<sup>\*</sup>, излучающих широкий континуум ( $4^2\Gamma - 1^2\Gamma$ ) при 245 nm. Измерены радиационные времена высвечивания и константы тушения континуума ( $\lambda_{\text{max}} = 245 \text{ nm}$ ) компонентами газовой смеси Ar, CCl<sub>4</sub>. Предложена плазмохимическая модель образования эксимерных молекул Ar<sub>2</sub>Cl<sup>\*</sup> в плотных газовых смесях (Ar + CCl<sub>4</sub>) при накачке заряженными частицами высокой энергии.

Ключевые слова: эксимер, молекула Ar<sub>2</sub>Cl\*, быстрые электроны, люминесценция.

DOI: 10.21883/OS.2021.09.51341.2173-21

### Введение

Ранее нами было обнаружено, что в плотных газовых смесях (Ar + CCl<sub>4</sub>) происходит образование эксимерных молекул Ar<sub>2</sub>Cl<sup>\*</sup>, излучающих широкий континуум в интервале длин волн 220–300 nm с максимумом при 245 nm. Молекулы Ar<sub>2</sub>Cl<sup>\*</sup> образовывались при повышенных давлениях инертного газа  $\sim 0.5$  atm, причем эффективность их образования возрастала при повышении давления Ar в газовой смеси.

Широкополосное излучение молекул  $Ar_2Cl^*$  обусловлено связанно-свободными переходами и характеризуется большими по сравнению с молекулами  $ArCl^*$  радиационными временами жизни — порядка 100–200 ns и выше [1–3]. Интенсивность континуума значительно превышает эмиссию газовой смеси  $Ar-N_2$  оптимального состава. Это излучение впервые наблюдалось в работе [4] при возбуждении плотной газовой смеси  $Ar-Cl_2$  пучком протонов и было интерпретировано как излучение молекулы  $Cl_2^*$ . Позднее в работах [3,5] оно было отнесено как принадлежащее молекуле  $Ar_2Cl^*$ .

В настоящее время имеющаяся в литературе информация по излучательным характеристикам эксимерной молекулы  $Ar_2Cl^*$  весьма ограничена. Теоретические работы [2,6,7] были связаны с проведением *ab initio* расчетов энергетических характеристик многих двухатомных и трехатомных эксимерных молекул инертных газов, включая Ar, однако информация для молекулы  $Ar_2Cl^*$ недостаточно полна. Имеющиеся экспериментальные данные представлены в работах [1,3–5], в которых рассмотрены излучательные характеристики этой молекулы в смесях  $Ar + Cl_2$ . В настоящей работе приводятся экспериментальные данные по излучательным характеристикам молекул Ar<sub>2</sub>Cl<sup>\*</sup>, образующихся в плотных газовых смесях Ar + CCl<sub>4</sub> различного состава при возбуждении импульсным пучком быстрых электронов с энергией 220 keV. Были измерены радиационные времена высвечивании континуума эксимерной молекулы Ar<sub>2</sub>Cl<sup>\*</sup> ( $\lambda_{max} = 245$  nm, переход  $4^2\Gamma - 1^2\Gamma$ ), определены константы тушения континуума компонентами газовой смеси (Ar, CCl<sub>4</sub>) и предложена модель плазмохимических процессов образования эксимерных молекул Ar<sub>2</sub>Cl<sup>\*</sup> при накачке заряженными частицами высокой энергии, согласующаяся с экспериментальными данными.

### Экспериментальная установка

Экспериментальные исследования проводились с использованием установки, ранее подробно описанной в работе [8]. Возбуждение газовых смесей  $Ar + CCl_4$  производилось импульсным пучком быстрых электронов ускорителя РАДАН-220. Энергия электронов пучка ~ 220 keV, длительность импульса ~ 5 пs. Газовые смеси различного состава приготавливались непосредственно в кювете, где производилось возбуждение электронным пучком. Использовались смеси различного состава с содержанием компонент 100–800 Torr чистого Ar и (0.005–5 Torr) CCl<sub>4</sub>. Тщательная очистка Ar от молекулярных примесей проводилась непосредственно в кювете перед напуском галогеносодержащей примеси (CCl<sub>4</sub>) путем непрерывной прокачки газа через фильтр, содержащий разогретую до 700°C титановую губку. Эта

процедура является крайне важной, так как наличие в смеси даже малых количеств молекулярных газов может вызвать сильное тушение эксимерной люминесценции. Полный цикл очистки газа обычно продолжался 8-10 min, после чего содержание остаточных молекулярных газов в очищаемом газе обычно не превышало  $10^{-4}$ %.

Для приготовления смесей с малым содержанием CCl<sub>4</sub> использовался двухступенчатый метод, когда в кювету добавляется не чистый газ CCl<sub>4</sub>, а смесь Ar + CCl<sub>4</sub> с высоким содержанием CCl<sub>4</sub> из отдельного мерного объема. Отношение этого объема к суммарному объему кюветы и подводящих коммуникаций было равно 1:100, что позволяло получать концентрации CCl<sub>4</sub> в газовой смеси  $\sim 0.1\%$  и ниже с высокой точностью. Смешивание газов из мерного и основного объемов осуществлялось циркуляционным насосом при отключенном титановом фильтре после завершения процедуры очистки основного газа Ar.

Спектральные измерения люминесценции газовой смеси Ar + CCl<sub>4</sub> производились в диапазоне длин волн 200-1200 nm с использованием спектрометра MAYA2000Pro с ПЗС-матрицей. Спектрометр МАҮА2000Pro регистрирует с разрешением 0.5 nm интегральный во времени спектр светового излучения (минимальное время интеграции составляет 6 ms) за все время действия импульса накачки и последующего распада плазмы. Временные измерения континуума эксимерной молекулы Ar<sub>2</sub>Cl\* на длине волны 245 nm выполнялись с помощью ФЭУ-100 и монохроматора МДР-23, используемого в качестве перестраиваемого фильтра для выделения исследуемого участка спектра шириной 4 nm. Фотоумножитель ФЭУ-100 работал в токовом режиме на нагрузку 50 Ω, запись сигнала производилась цифровым осциллографом TektronixTDS 1012.

### Результаты измерений и обсуждение

Трехатомная молекула  $Ar_2Cl^*$  излучает широкий континуум в диапазоне длин волн 220–300 nm с максимумом при 245 nm. Согласно [1], это излучение обусловлено переходами между сильно связанным ионным верхним состоянием молекулы  $Ar_2Cl^*$ , образованным из ионов  $Ar_2^+$  и  $Cl^-$ , и нижним разлетным состоянием, образованным молекулой  $Ar_2^*$  и атомом Cl в основном состоянии.

На рис. 1 показан интегральный во времени спектр люминесценции газовой смеси Ar-CCl<sub>4</sub> при возбуждении импульсным пучком быстрых электронов с энергией 220 keV длительностью 5 ns. В области длин волн 200–1200 nm спектр состоит из полосы эксимерной молекулы Ar<sub>2</sub>Cl<sup>\*</sup> ( $\lambda_{max} = 245$  nm) в ультрафиолетовом диапазоне, линейчатого излучения при 308 nm и группы 4*p*-4*s*-линий ArI в длинноволновой области ( $\lambda > 650$  nm). Происхождение излучения с длиной волны 308 nm связано с реакцией рекомбинации молекуляр-



**Рис. 1.** Аппаратурный спектр люминесценции газовой смеси Ar-CCl<sub>4</sub> при возбуждении импульсным пучком быстрых электронов ( $E_e = 220$  keV, T = 5 ns). Состав смеси: Ar — 768 Torr, CCl<sub>4</sub> — 0.015 Torr.

ного иона  $Ar_2^+$ :

$$Ar_{2}^{+} + e \to Ar_{2}^{*} + hv$$
 (308 nm). (1)

В приведенном спектре отсутствует B-X-полоса двухатомной эксимерной молекулы ArCl\* ( $\lambda_{max} = 175$  nm), поскольку это излучение лежит вне диапазона измеряемых длин волн спектрометром MAVA2000Pro и поэтому в приведенном на рис. 1 спектре не наблюдается. Полуширина  $4^2\Gamma - 1^2\Gamma$  полосы эксимерной молекулы Ar<sub>2</sub>Cl\* ( $\lambda_{max} = 245$  nm) равна  $\Delta \lambda = 30$  nm (рис. 1).

С увеличением концентрации CCl<sub>4</sub> в спектре излучения газовой смеси Ar-CCl<sub>4</sub> уменьшается интенсивность всех атомарных 4p-4s-линий ArI. Это объясняется снижением концентрации электронов в газовой среде из-за увеличения скорости прилипания электронов к молекулам CCl<sub>4</sub> при увеличении парциального давления CCl<sub>4</sub> и в связи с этим снижением скорости диссоциативной рекомбинации молекулярных ионов Ar<sub>2</sub><sup>+</sup>.

При давлении Ar 800 Torr оптимальное парциальное давление CCl<sub>4</sub> в смеси, соответствующее максимальному световыходу полосы  $4^2\Gamma - 1^2\Gamma$  молекулы Ar<sub>2</sub>Cl<sup>\*</sup>, равно 0.15 Torr. В табл. 1 приведены энергетические характеристики основных компонент плазмы Ar + CCl<sub>4</sub>, связанные с образованием эксимерных молекул ArCl<sup>\*</sup> и Ar<sub>2</sub>Cl<sup>\*</sup>.

Измерения временных характеристик люминесценции молекул Ar<sub>2</sub>Cl<sup>\*</sup> проводились для смесей, содержащих 0.005–10.0 Torr CCl<sub>4</sub> и 200–835 Torr Ar, и были выполнены на длине волны 245 nm, соответствующей максимальным значениям интенсивности  $4^{2}\Gamma-1^{2}\Gamma$ -полосы молекулы Ar<sub>2</sub>Cl. На рис. 2 приведены измеренные кривые высвечивания на длине волны 245 nm для газовых смесей с содержанием 0.005 Torr CCl<sub>4</sub> (рис. 2, *a*) и 0.5 Torr CCl<sub>4</sub> (рис. 2, *b*) при давлении аргона 800 Torr. Первый узкий пик на осциллограмме (длительностью 5 ns) соответствует импульсу электронов накачки электронного

Компонента плазмы	Параметр	Энергия, eV	Источник
$\mathrm{Ar}^+$	Потенциал ионизации	$\begin{array}{c} 15.759 \ (^2P^0_{3/2}) \\ 15.93 \ \ (^2P^0_{1/2}) \end{array}$	[9] [9]
$Ar_2^+$	Потенциал образования Глубина потенциальной ямы	14.71 1.23	[10] [10]
$\operatorname{Ar}^*(3p^54s)$	Энергетический уровень	$\begin{array}{c} 11.83 \ (^{1}P_{1}) \\ 11.72 \ (^{3}P_{0}) \\ 11.62 \ (^{3}P_{1}) \\ 11.55 \ (^{3}P_{2}) \end{array}$	[9]
$\operatorname{Ar}_2^*$	Глубина потенциальной ямы	$\begin{array}{c} 0.74 \ (^{1}\Sigma_{u}^{+}) \\ 0.68 \ (^{3}\Sigma_{u}^{+}) \\ 2.4 \cdot 10^{-2} \ (^{1}\Sigma_{u}^{+}) \end{array}$	
Cl-CCl <sub>3</sub> C-Cl	Энергия разрыва связи	2.9–2.916 2.8	[10,11] [10]
$\mathrm{CCl}_4^-$	Сечение прилипания электрона ( $E_e = 0.05  \text{eV}$ )	$(1.2-1.4) \cdot 10^{14} \mathrm{cm}^2$	[12]
$\begin{array}{c} \mathrm{CCl}_3^-\\ \mathrm{Cl}^- \end{array}$	Энергия сродства к электрону	$> 2.10 \pm 0.35$ 3.82	[10]

**Таблица 1.** Энергетические характеристики компонента плазмы (Ar–CCl<sub>4</sub>), связанные с образованием эксимерных молекул ArCl\* и Ar<sub>2</sub>Cl\*



**Рис. 2.** Временные осциллограммы: Ar — 782 Torr, CCl<sub>4</sub> — 0.005 Torr (*a*); Ar — 800 Torr, CCl<sub>4</sub> — 0.5 Torr (*b*).

ускорителя РАДАН-220, а второй, широкий пик с амплитудой  $U_0$  — излучению эксимерной молекулы Ar<sub>2</sub>Cl<sup>\*</sup>. Заселение верхнего уровня  $4^2\Gamma - 1^2\Gamma$  полосы молекулы Ar<sub>2</sub>Cl<sup>\*</sup> происходит постепенно в течение временного интервала ~ 70 ns при высоких концентрациях CCl<sub>4</sub> и

увеличивается до 200–250 ns при низких. Такие времена задержки коррелируют с временем образования молекулярного иона  $Ar_2^+$  и процессом ион-ионной рекомбинации ионов  $Ar_2^+$  и  $Cl^-$ .

На рис. 3 приведены временные осциллограммы импульсов люминесценции для газовых смесей с содержанием CCl<sub>4</sub> в смеси от 0.15 до 10 Torr. На рис. 4 пока-



**Рис. 3.** Временные осциллограммы импульсов люминесценции газовой смеси Ar-CCl<sub>4</sub> на длине волны 245 nm. Состав смеси: Ar — 800 Torr, CCl<sub>4</sub> — 0.155 (1), 0.31 (2), 0.75 (3), 1.25 (4), 2.5 (5), 5.0 (6), 10 Torr (7).



**Рис. 4.** Относительный световыход *S* излучения полосы  $4^2\Gamma - 1^2\Gamma$  молекулы  $Ar_2Cl^*$  ( $\lambda_{max} = 245$  nm) и амплитуда световой вспышки  $U_0$  в зависимости от парциального давления CCl<sub>4</sub> в смеси. Давление Ar — 800 Torr.

заны амплитуда световой вспышки U0 и относительный световыход S полосы молекулы  $Ar_2Cl^*$  ( $\lambda_{max} = 245 \text{ nm}$ ) в зависимости от парциального давления CCl<sub>4</sub> в смеси. Световыход S определялся как площадь временной осциллограммы за вычетом площади пика импульса накачки ускорителя. Видно, что световыход полосы молекулы  $Ar_2Cl^*$  ( $\lambda_{max} = 245 \text{ nm}$ ) снижается при увеличении концентрации CCl<sub>4</sub>, в то время как амплитуда U<sub>0</sub> световой вспышки меняется не так сильно — при изменении парциального давления CCl<sub>4</sub> в смеси от 0.005 до 10.0 Torr  $U_0$  изменяется от 3.5 V (0.005 Torr) до 0.4 V (10 Torr). Это указывает на то, что тушение эксимерной люминесценции происходит на стадии послесвечения, а не на стадии образования эксимерной молекулы. Фактически амплитуда U<sub>0</sub> характеризует количество образовавшихся возбужденных молекул Ar<sub>2</sub>Cl\*, которое в данном случае слабо зависит от концентрации CCl<sub>4</sub> в смеси. При определенных условиях накачки эти возбужденные молекулы Ar<sub>2</sub>Cl\* могут быть эффективно использованы в режиме генерации до момента их тушения молекулами CCl<sub>4</sub> в средах с большим содержанием донора галогена типа CCl<sub>4</sub>.

Измерения кривых высвечивания молекулярной полосы  $Ar_2Cl^*$  для смесей  $Ar + CCl_4$  различного состава позволяют определить константы тушения этой полосы компонентами смеси. На рис. 5,6 приведены зависимости обратного времени высвечивания 1/t полосы  $4^2\Gamma - 1^2\Gamma$  молекулы  $Ar_2Cl$  ( $\lambda_{max} = 245$  nm) от содержания  $CCl_4$  (рис. 5) и Ar (рис. 6) в смеси. Из этих зависимостей были определены радиационные времена высвечивания и константы тушения полосы  $Ar_2Cl^*$  молекулами  $CCl_4$  и атомами Ar. Они оказались соответственно равны:

$$t_0 = 400 \text{ ns}, \quad k = 5 \cdot 10^{-10} \text{ cm}^3/\text{s} (\text{CCl}_4),$$
  
 $k = 4.4 \cdot 10^{-14} \text{ cm}^3/\text{s} (\text{Ar}).$  (2)

Учитывая, что полуширина  $4^{2}\Gamma - 1^{2}\Gamma$ -полосы Ar<sub>2</sub>Cl  $\Delta \lambda = 30$  nm, это позволяет определить сечение вынужденного испускания  $\sigma_{c}$  и плотность энергии насыщения  $Q_s$  для этого перехода:

$$\sigma_c = \lambda^4 / 8\pi c t_0 \Delta \lambda = 3.9 \cdot 10^{-19} \,\mathrm{cm}^2,$$
 (3)

$$Q_s = h\nu/\sigma_c = 2.06 \,\mathrm{J/cm^2}.$$
 (4)

## Плазмохимическая модель образования эксимерных молекул Ar<sub>2</sub>Cl заряженными частицами высокой энергии

Основные кинетические процессы, приводящие к образованию эксимерных молекул Ar<sub>2</sub>Cl\* при накачке



**Рис. 5.** Обратное время высвечивания  $1/t_0$  полосы  $4^2\Gamma - 1^2\Gamma$  молекулы Ar<sub>2</sub>Cl\* ( $\lambda_{max} = 245$  nm) в зависимости от парциального давления CCl<sub>4</sub> при высоких (*a*) и низких (*b*) концентрациях CCl<sub>4</sub> в смеси. Давление Ar — 800 Torr.



**Рис. 6.** Обратное время высвечивания  $1/t_0$  полосы  $4^2\Gamma - 1^2\Gamma$  молекулы Ar<sub>2</sub>Cl<sup>\*</sup> ( $\lambda_{max} = 245$  nm) в зависимости от парциального давления Ar в смеси. Парциальное давление CCl<sub>4</sub> — 0.045 Torr.

N⁰	Реакции	Константы скорости	Источник
1	$\begin{array}{c} \operatorname{Ar} + (e_f, e_{\delta}) \to \operatorname{Ar}^+ + e + (e_f, e_{\delta}) \\ \operatorname{Ar} + (e_f, e_{\delta}) \to \operatorname{Ar}^* + (e_f, e_{\delta}) \end{array}$	$w = E/N(\mathrm{Ar^+}) = 1.7I = 26.79 \mathrm{eV}$ $N(\mathrm{Ar^*}) = 0.4N(\mathrm{Ar^+}) \mathrm{cm^{-3}}$ $E_e = 0.31I = 4.88 \mathrm{eV}$	[13]
2	$Ar^+ + 2Ar \rightarrow Ar_2^+ + Ar$	$(1.8-3.5) \cdot 10^{-31}  \text{cm}^6/\text{s}$	[13]
3	$Ar^* + 2Ar \rightarrow Ar_2^* + Ar$	$(2.5-8.5) \cdot 10^{-32}  \text{cm}^6/\text{s}$	[13]
4	$\operatorname{Ar}_2^+ + e  o \operatorname{Ar}^*(4p) + \operatorname{Ar}$	$8.1 \cdot 10^{-5} T_e^{-0.6}$	[13]
5	$\operatorname{CCl}_4 + e \to (\operatorname{CCl}_4)^- \to \operatorname{CCl}_3 + \operatorname{Cl}^-$	$\sigma = (1.2 - 1.4) \cdot 10^{-14} \mathrm{cm}^2 ($ для $E_e = 0.05 \mathrm{eV})$ $7 \cdot 10^{-8} \mathrm{cm}^3$ /s, (для $T_e = 0.25 \mathrm{eV})$	[12] [14]
6	$\mathrm{Ar^+} + \mathrm{Cl^-} + \mathrm{Ar} \to \mathrm{Ar}\mathrm{Cl^*} + \mathrm{Ar}$		
7	$Ar{+}2^+ + Cl^- + Ar \rightarrow Ar_2Cl^* + Ar$		
8	$\operatorname{ArCl}^* \to \operatorname{Ar} + \operatorname{Cl} + h\nu \ (175\mathrm{nm})$		
9	$Ar_2Cl^* \rightarrow 2Ar + Cl + h\nu ~(245 \text{ nm})$	$t_0 = 400 \text{ ns}$ $t_0 = 240 \pm 40 \text{ ns}$ $t_0 = 654 \text{ ns}$	Настоящая работа [3] [2]
10	${ m Ar_2Cl^*+CCl_4} ightarrow$ продукты	$k = 5 \cdot 10^{-10} \mathrm{cm^3/s}$	Настоящая работа
11	$\mathrm{Ar_2Cl}^* + \mathrm{Ar}  ightarrow$ продукты	$k = 4.4 \cdot 10^{-14} \mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$	Настоящая работа

Таблица 2. Основные плазмохимические реакции при возбуждении плотной газовой смеси Ar + CCl<sub>4</sub> электронами высокой энергии

Примечание.  $e_f, e_\delta$  — электроны накачки и электроны ионизационного каскада; E — энергия электронов накачки; w — энергия образования пары (Ar<sup>+</sup> + e);  $N(\text{Ar}^+)$ ,  $N(\text{Ar}^+)$ ,  $E_e$  — число ионов Ar<sup>+</sup>, возбужденных атомов Ar<sup>\*</sup> и средняя энергия вторичных электронов, образованных электроном накачки с энергией E;  $T_e$  — температура электронов.

плотных газовых смесей Ar–CCl<sub>4</sub> заряженными частицами высокой энергии, приведены и пронумерованы в табл. 2. Там же указаны коэффициенты скоростей реакций по данным разных авторов.

Эксимерные молекулы  $Ar_2Cl^*$  образуются в многоступенчатом процессе, включающим реакции образования отрицательных ионов  $Cl^-$ , положительных ионов  $Ar_2^+$ и ион-ионную рекомбинацию ионов  $Ar_2^+$  и  $Cl^-$ . Анализ имеющихся экспериментальных данных по ядерной накачке газовых сред показывает, что при возбуждении плотных газовых смесей типа Rg + X заряженными частицами высокой энергии (здесь Rg — инертный газ, X — галоген) основным каналом образования двухатомных и трехатомных эксимерных молекул являются реакции ион-ионной рекомбинации положительных ионов  $Rg^+$  и  $Rg_2^+$  с отрицательными ионами галогена (реакции 6, 7), а вклад других каналов образования эксимерных молекул существенно меньше.

Быстрая заряженная частица высокой энергии (в нашем случае электрон с энергией 220 keV) при прохождении через газовую среду Ar–CCl<sub>4</sub> с низким содержанием галогеносодержащей примеси передает всю свою энергию атомам аргона, образуя ионы Ar<sup>+</sup>, возбужденные атомы Ar<sup>\*</sup> и электроны ионизационного каскада (реакция 1). При высоком давлении буферного газа (~ 1 atm) вследствие тройных соударений атомарные ионы Ar<sup>+</sup>, а возбужденные атомы Ar<sup>\*</sup> — в возбужденные атомы Ar<sup>\*</sup> – в возбужденные атома атома атома атома атома атома атома атома Ar<sup>\*</sup> – в возбужденные атома А

ные молекулы Ar<sub>2</sub><sup>\*</sup> (реакции 2, 3). Электроны ионизационного каскада термализуются, теряя свою энергию при неупругих и упругих соударениях с атомами Ar. Согласно [13], время замедления первичных электронов совместно со вторичными электронами ионизационного каскада и установление стационарного энергетического распредления электронов в Ar при атмосферном давлении составляет 5-10 ns. Термализованные электроны активно участвуют в диссоциативной рекомбинации молекулярного иона Ar<sup>+</sup> (реакция 4) и в образовании отрицательных ионов CCl<sub>4</sub> за счет прилипания к электроотрицательной примеси (реакция 5). Прилипание к молекулам CCl<sub>4</sub> сопровождается диссоциацией этих молекул с образованием отрицательно заряженных радикалов молекул CCl<sub>3</sub><sup>-</sup>, CCl<sub>2</sub><sup>-</sup>, Cl<sub>2</sub><sup>-</sup> и Cl<sup>-</sup> [14]. Собственно ионы CCl<sub>4</sub> не образуются вследствие того, что энергия диссоциации этого молекулярного иона,

$$\operatorname{CCl}_4^- \to \operatorname{CCl}_3 + \operatorname{Cl}^-,\tag{5}$$

лежит на 0.5 eV ниже основного состояния молекулы CCl<sub>4</sub>. Это позволяет электронам с нулевой энергией создавать ионы Cl<sup>-</sup>. Электроны больших энергий (~ нескольких eV) при прилипании могут сильнее разрушать молекулу CCl<sub>4</sub> и образовывать ионы CCl<sub>3</sub><sup>-</sup>, CCl<sup>-</sup>, CCl<sup>-</sup>, однако вероятность процесса сильно уменьшается с ростом энергии электронов. Суммарный вклад всех этих ионов не превышает 0.1% от числа ионов Cl<sup>-</sup> [14]. Эксимерные молекулы  $ArCl^*$  и  $Ar_2Cl^*$  распадаются радиационно (реакции 8,9) и испытывают столкновительное тушение при соударениях с атомами Ar и молекулами CCl<sub>4</sub> (реакции 10, 11).

### Заключение

В работе были экспериментально измерены характеристики люминесценции эксимерной молекулы Ar<sub>2</sub>Cl, образующейся в плотной газовой смеси Ar–CCl<sub>4</sub> при возбуждении быстрыми электронами ( $E_e = 220 \text{ keV}$ ). Для  $4^2\Gamma - 1^2\Gamma$ -перехода молекулы Ar<sub>2</sub>Cl\* были определены длина волны ( $\lambda_{\text{max}} = 245 \text{ nm}$ ), соответствующая максимуму интенсивности, определены радиационное время высвечивания ( $t_0 = 400 \text{ ns}$ ) и полуширина полосы ( $\Delta \lambda = 30 \text{ nm}$ ), а также сечение вынужденного испускания ( $3.9 \cdot 10^{-19} \text{ cm}^2$ ) и плотность энергии насыщения для этого перехода (2.06 J/cm<sup>2</sup>).

Были измерены также константы тушения  $4^{2}\Gamma - 1^{2}\Gamma$ полосы  $Ar_{2}Cl^{*}$  молекулами  $CCl_{4}$  и атомами Ar. Они оказались соответственно равны  $5 \cdot 10^{-10}$  cm<sup>3</sup>/s ( $CCl_{4}$ ) и  $4.4 \cdot 10^{-14}$  cm<sup>3</sup>/s (Ar). Было обнаружено, что тушение эксимерной люминесценции компонентами плазмы происходит на стадии послесвечения, а не на стадии образования эксимерной молекулы. В связи с этим при определенных условиях накачки молекулы  $Ar_{2}Cl^{*}$  эффективно использованы в режиме генерации до момента их тушения молекулами  $CCl_{4}$  в средах с большим содержанием донора галогена типа  $CCl_{4}$ .

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

### Список литературы

- [1] Huestis D.L., Marowsky G., Tittel F.K. // Excimer Lasers / Ed. by Rhodes Ch.K. Springer-Verlag, 1984. P. 181–216.
- [2] Alekseev V.A. // J. Phys. B. 2014. V. 47. P. 105101. doi 10.1088/0953-4075/47/10/105101
- [3] Liegel J., Spiegel H., Sauerbrey R., Langhoff H. // J. Chem. Phys. 1983. V. 79. N 1. P. 247. doi 10.1063/1.445564
- [4] Chen C.H., Payne M.G. // Appl. Phys. Lett. 1976. V. 28. N 4. P. 219.
- [5] Lorents D.C., Huestis D.L., McCusker M.V., Nakano H.H., Hill R.M. // J. Chem. Phys. 1978. V. 68. N 10. P. 4657.
- [6] Wadt W.R., Hay P.J. // Appl. Phys. Lett. 1977. V. 30. N 11.
   P. 573.
- [7] Dunning T.H., Hay P.J. // Appl. Phys. Lett. 1976. V. 28. N 11.
   P. 649.
- [8] Миськевич А.И., Подкопаев А.В. // Приборы и техника эксперимента. 2017. № 3. С. 154–159.
- [9] Стриганов А.Р., Свентицкий Н.С. Таблицы спектральных линий нейтральных и ионизованных атомов. М.: Атомиздат, 1966. 899 с.
- [10] Таблицы физических величин. Справочник. М.: Атомиздат, 1976. 1006 с.

- [11] Kolts J.H., Velazco J.E., Setser D.W. // J. Chem. Phys. 1979.
   V. 71. P. 1247.
- [12] Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: Наука, 1987. 591 с.
- [13] Мельников С.П., Сизов А.Н., Синянский А.А. Лазеры с ядерной накачкой. Саров, 2008. 439 с.
- [14] Scheunemann H.-U., Illenberger E., Baumgartel H. // Berichte der Bunsen gesellschaft für physikalische Chemie. 1980. P. 580.